

公開番号 又は 特許番号	特許 5044685
発明名称	マイクロプローブ、記録装置、及びマイクロプローブの製造方法
出願人 又は 権利者	株式会社東芝、 国立大学法人東京大学
想定デバイス	アンビエントデバイス、その他
要約	<p>【利用分野】</p> <p>走査型プローブ顕微鏡（SPM: Scanning Probe Microscope）の原理を利用したプローブ型MEMSメモリに関するもの。</p> <p>【発明の内容】</p> <p>プローブ先端部を安価かつ容易に製造できるマイクロプローブを提供する。そのために、保護台、絶縁層、電極層がこの順番で第1の方向に配列したマイクロプローブが提供される。前記第1の方向とは異なる第2の方向に形成された前記マイクロプローブの主面において、少なくとも前記電極層に段差が形成され、この段差により前記電極層が第1の領域と第2の領域とに区画される。</p>
図面	<p>図1</p> <p>(a)</p> <p>(b)</p>